

# マスク移動機構 [PMI-701]

[概要] 本機構は成膜装置内部基板に近接した位置に設置され成膜移動させる事により各種のマスクパターンに従った形状の成膜を基板上に転写する事が出来ます。  
シーケンサーによるプログラム制御により傾斜成膜、ドット成膜等が出来ます。



## [特長]

1. マスクの交換が容易で、基板上に各種のパターンを転写する事が出来ます。
2. シーケンサ制御により蒸発源の同期制御が出来、正確なパターン成膜が出来るとともに自動成膜が可能です。
3. レシピは16ステップと豊富なパターン選択が可能です。
4. タッチパネル操作により取り扱いが容易です。

主な仕様

項目	仕様	備考
移動距離	直進方向 70mm パルスモーター駆動 直行方向 ±3mm 手動	
マスクプレート	SUS304 30mm x 1 t	パターンは別途御相談
ベーキング	180℃	
制御項目	マスク移動、ターゲット公転制御 レーザーショット制御	
制御プログラム	1) 最大 16 ステップ ・原点 ・2 ポジション設定 ・移動時間設定 ・外部 2 種 TT2 制御 2) 表示 5 インチタッチパネル KV-3000, MC-20-V 使用	
取付フランジ	114 CF に準ずる	

注) 尚性能向上のため予告なく仕様を変更する事があります。

---

## PVR(Professional Vacuum Research)

### 真空機器技術コンサルティング

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-26-2

TEL・FAX：027-226-5491

E-mail：tetsuomaebashi@yahoo.co.jp

URL：http://www.pvr-ishida.com/